

Możliwości pomiarowe

CMM

Ultraprecyzyjne pomiary stykowe i optyczne

SKAN 3D

Skanowanie optyczne w technologii światła laserowego i strukturalnego

μ CT

Techniczna tomografia komputerowa

TOPO

Pomiary optyczne i stykowe nierówności powierzchni w skali mikro

SEM

Analiza struktury powierzchni w skali subnanometrycznej

MULTI

Ultraprecyzyjne pomiary w skali nano-, mikro- oraz makro-

KONTAKT



zmisp@put.poznan.pl



**ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań**



„Nie ma pomiarów bez teorii i nie ma teorii bez pomiarów”

J. Chajda



Multiskalowe laboratorium współrzędnościowej techniki pomiarowej im. prof. Jana Chajdy



WYDZIAŁ
INŻYNIERII
MECHANICZNEJ



O nas

Od blisko 50 lat Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Poznańskiej zajmuje się wykonywaniem dokładnych pomiarów oraz konstrukcją urządzeń pomiarowych. Dziś z powodzeniem współpracujemy z przedstawicielami różnych środowisk stanowiąc pomost między nauką i otoczeniem gospodarczym.

Naszym celem jest realizacja pomiarów na najwyższym poziomie metrologicznym.

Swoje doświadczenie i pasję do metrologii rozwijamy korzystając ze sprzętu najwyższej światowej klasy.



CMM

Pomiar stykowy i optyczny elementów wykonywany na Współrzędnościowych Maszynach Pomiarowych, w tym Leitz PMM – C 12 10 7 ze stołem obrotowym, będącym dodatkową – czwartą osią maszyny, która rozszerza klasyczne możliwości pomiaru o digitalizację najbardziej złożonych geometrii, jak np. łopatkę, czy koła zębate.

MULTI

Pomiar multiskalowy realizowany na Optiv Reference 763 Dual Z, który łączy pomiary w skali makro-, mikro- oraz nano, np. płytki PCB.

TOPO

Bezstykowy system pomiarowy Alicona μ CMM - optyczna, współrzędnościowa maszyna pomiarowa z sensorami pomiarowymi pracującymi w technologii różnicowania ogniskowego o rozdzielczościach nanometrycznych do pomiaru geometrii i topografii powierzchni.

SKAN 3D

Skanowanie optyczne przedmiotów w skali makro realizowane za pomocą różnego typu skanerów (Creaform CUBE – R, HandySCAN BLACK), gwarantujących dokładny pomiar szerokiej gamy elementów o różnych cechach powierzchni i zróżnicowanych gabarytach i geometrii.

μ CT

Tomografia komputerowa (microCT) phoenix V|tome|x M, pozwalający na pomiar geometrii wewnętrznych (np. kanały) oraz struktur wewnętrznych (np. porowatości), które są niedostępnych dla innych technik bez ich zniszczenia.

SEM

Analiza struktury materiału w skali subnanometrycznej z JEOL JSM-IT700HR/LV z emisją polową (emiter Schottky'ego) oraz możliwością pracy w warunkach wysokiej i niskiej próżni.